

SCAN TECH 2022

SEM の基礎 手取り足取り 前処理・観察・分析まで

日時：2022年8月26日（金）10:00～17:00

場所：関東（東京または横浜）対面式とオンラインを併用したハイブリッド開催

参加費：1,000円

開会挨拶

理化学研究所・豊岡 公徳

基礎講座（10時～11時30分）

1. ミクロトームによる材料系試料のSEM試料作製

ライカマイクロシステムズ・長澤 忠広

2. Low-Vacuum が High-Value！卓上低真空走査電顕の特性を活かした生体構造解析と
新たな金ナノ粒子免疫標識法の未知なる可能性

宮崎大学・澤口 朗

3. 金属材料の機械的性質の理解と評価のための走査電子顕微鏡法とその周辺技術

九州大学・光原 昌寿

講師ブレイクアウトルーム（11時30分～12時）

企業展示（11時30分～13時）

SEMメーカーセッション（13時～14時）

休憩10分

分析基礎講座（14時10分～15時10分）

4. EDX法 -- 元素分析の基礎と分析条件の影響 --

オックスフォード・インストゥルメンツ・三井 千珠

5. EBSD法 -- 結晶方位の表現と結晶方位マップの見方 --

TSLソリューションズ・鈴木 清一

特別講演（15時10分～15時40分）

6. 顕微鏡観測された2次元粒径分布及び粒子形状の3次元変換

産業技術総合研究所・上田 高生

閉会挨拶

ファインセラミックスセンター・横江 大作

講師ブレイクアウトルーム・企業展示（15時40分～16時10分）

情報交換会・企業展示（～17時）

※1： コロナウイルス感染症の状況によって開催方法・開催場所を変更する可能性があります。